|  |
| --- |
| **國立成功大學核心設施中心微奈米科技組　校內教學參訪申請表**2022.12.21修訂**表1** |
| 教授姓名 |  | 系所名稱 |  |  |
| 電話／手機 |  | Eｍail |  |  |
| 課程名稱 |  |  |
| 申請日期 | (yy)/(mm)/(dd) | 參訪日期 | (yy)/(mm)/(dd) |  |
| 參訪人數 | 教授：　　人研究生：　　人＊以20人為限 | 參訪時間 | □上午　　時　　分至　　時　　分□下午　　時　　分至　　時　　分＊以2小時為限  |  |
|  |
| 參訪當日聯絡人 | 姓　名： | 職　稱： |  |
| 電話／手機： | E-Mail： |  |
| 參觀儀器 | 請於**表2**勾選；共4個領域，限勾選至多2個領域內的儀器。每個領域參訪至多1小時。 |  |
| 備註 | （若有其他需求請填寫） |  |

**注意事項**：

一、為輔助**本校研究所（以上）**專業領域教學，特辦理本教學參訪。

二、星期三不開放參訪。參訪申請須於參訪日之一個月前提出，經確認後，承辦人會以電子郵件回覆聯絡人。若需更改時間或取消，請於參訪日之1週前以電話或email告知承辦人。

三、請詳閱並遵守本中心無塵室與奈米檢測與分析實驗室相關規範（<https://cmnst-cfc.ncku.edu.tw/p/412-1197-14658.php?Lang=zh-tw>）。

四、參訪人員安全由參訪單位自行維護。

五、上述未盡事宜，本中心保留更動權益。

承辦人：林 專員

Tel: 06-2757575轉31380轉202

Email: walin@ncku.edu.tw

**表2**

|  |
| --- |
| **領域1－奈米微影製程** |
| 勾選 | 儀器名稱 | 勾選 | 儀器名稱 |
|  | 電子束微影系統(Electron Beam Lithography System) |  | 反應式離子蝕刻機(Reactive Ion Etching) |
|  | 雙面對準/UV光感奈米壓印機(Double-Side Mask Aligner/ UV Imprinter) |  | 感應耦合電漿離子蝕刻機(Inductive Coupled Plasma Etching System) |
|  | 單面光罩對準機(Single-Side Mask Aligner) |  | 晶圓切割機(Wafer Cutting Machine) |
|  | 雙面光罩對準機(Double-Side Mask Aligner) |  | 打線機(Wire Bonding) |
|  | 旋轉塗佈儀 (Spin Coater) |  |  |

|  |
| --- |
| **領域2－奈米表面與磊晶** |
| 勾選 | 儀器名稱 | 勾選 | 儀器名稱 |
|  | 表面粗度儀(Alpha-Step Profilometer) |  | 化學氣相沉積石墨烯設備(Chemical Vapor Deposition for Graphene) |
|  | 電子束蒸鍍機 (E-beam Evaporator) |  | 原子力顯微鏡(Atomic Force Microscope, NTMDT-AFM) |
|  | 磁控濺鍍機(Magnetron Sputter Deposition System) |  | 多功能掃描式探針顯微鏡 (Multi-Functional Scanning Probe Microscope, Dimension Icon) |
|  | 共濺鍍機(Co-Sputter Deposition System) |  | 奈米壓痕試驗機 (Nano-Indentation System) |
|  | 半導體元件量測平台 (Measurement Station for Electrical Characterization) |  |  |

|  |
| --- |
| **領域3－奈米材料分析** |
| 勾選 | 儀器名稱 | 勾選 | 儀器名稱 |
|  | 雙束型聚焦離子束儀  (Dual Beam-Focused Ion Beam) |  | 桌上型掃描式電子顯微鏡(Tabletop SEM) |
|  | 精密離子拋光機(Precision Ion Polishing System) |  | 穿透式電子顯微鏡(TEM, JEOL JEM-2010) |
|  | 高解析熱場發射掃描式電子顯微鏡 I(FE-SEM I w EDS/CL/EBW, JEOL JSM-7000F) |  | 高解析場發射掃描穿透式電子顯微鏡(FE-TEM w EDS/EELS, JEOL JEM-2100F) |
|  | 高解析熱場發射掃描式電子顯微鏡 II(FE-SEM II w EDS/EBSD, JEOL JSM-7001F) |  | In-Situ 奈米壓痕試驗機(In-Situ Nano-Indentation System @ TEM) |

|  |
| --- |
| **領域4－生醫暨非破壞性分析** |
| 勾選 | 儀器名稱 | 勾選 | 儀器名稱 |
|  | 多光子激發掃描顯微鏡(Multiphoton Excitation Microscope) |  | 橢圓偏光儀(Ellipsometer) |
|  | 微拉曼及微光激發光譜儀(Micro-Raman & Micro-PL Spectrometer) |  | 接觸角量測儀(Contact Angle Meter) |
|  | 拉曼光譜儀／顯微鏡(Raman Spectrometer/Microscopes ) |  | X光繞射儀(X-Ray Diffractometer) |
|  | 傅立葉轉換紅外光光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer) |  | 動態光散射儀(Dynamic Light Scattering) |
|  | 紫外光-可見光-近紅外光分光光譜儀(UV/Visible/NIR Spectrophotometer) |  | 奈米粒子追蹤分析儀(Nanoparticle Tracking Analysis) |